

Список литературы

- [1] Искаков Р.С., Кирко В.И., Кузовников А.А. и др. Труды 1Х НЕРФ, Новосибирск, 1986. С. 70-74.
- [2] Гогуля Н.Ф., Воскобойников И.М., Простосердов А.И. // ФГВ. 1985. № 3. С. 110-113.
- [3] Баум Ф.А., Орленко Л.П., Станюкович К.П. и др. // Физика взрыва. М.: Наука, 1975. 704 с.
- [4] Кирко В.И., Кузовников А.А. // ФГВ. 1988. № 6. С. 19-24.

Красноярский государственный
университет

Поступило в Редакцию
8 января 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 10

26 мая 1989 г.

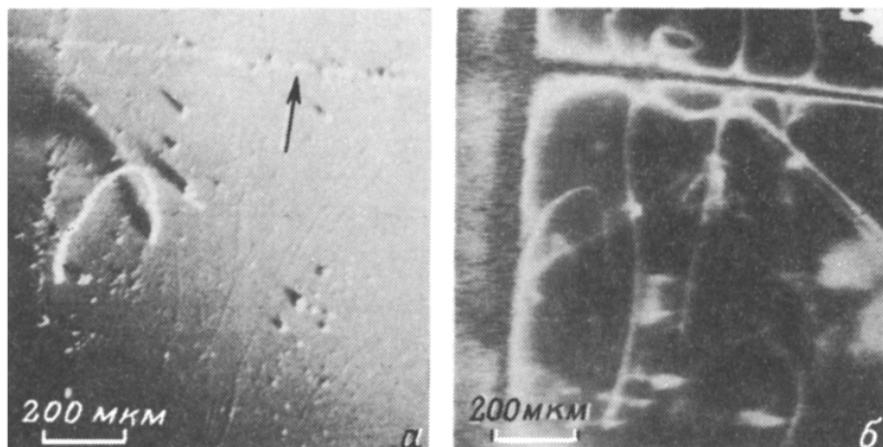
06.2; 11

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕКОМБИНАЦИОННОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПЛАСТИН В РЭМ С СВЧ-ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ

А.Е. Лукьянов, А.А. Патрин,
А.М. Янченко

Электрически активные неоднородности в полупроводниковых пластинах и структурах традиционно выявляются в растровом электронном микроскопе, работающем в режиме наведенного тока (см., например, [1]). Для осуществления таких измерений в пластинах, на их поверхности формируют энергетический барьер (например, барьер Шоттки или р-п переход). Технологические операции формирования барьера, как правило, являются разрушающими. Кроме того, чувствительность к рекомбинационно-активным центрам в барьерных структурах снижается вследствие особенностей процессов миграции носителей к барьера и условий разделения на нем.

Нами выполнены эксперименты на примере кремния по визуализации чисто рекомбинационной неоднородности в пластинах, не содержащих барьерных структур. Эксперименты базируются на описанной в работах [2-4] СВЧ-методике и аппаратуре анализа рекомбинационных параметров полупроводниковых пластин. В данном случае электронный зонд сканирующего электронного микроскопа *JSM-V-3*, прерываясь во времени с частотой 500 Гц, обеспечивал генерацию неравновесных носителей заряда в кремниевой пластине на участке $\sim 2 \text{ мм}^2$ на глубину до 9 мкм. Пластина закрывала отверстие малогабаритного СВЧ-преобразователя трехсанитметрового диапазона, введенного в камеру РЭМ. Переменный из-за модуляции электропроводности СВЧ-сигнал, пропорциональный



Микрофотографии участка поверхности кремниевой пластины в режимах упруго-отраженных электронов (а) и СВЧ-детектирования (б). Светлое поле на фото (б) соответствует меньшим значениям времени жизни носителей заряда.

концентрации избыточных носителей заряда и времени их жизни τ , после детектирования и усиления подавался на вход видеоусилителя РЭМ.

На рисунке приведены микрофотографии участка поверхности кремниевой пластины КЭФ-20 толщиной 400 мкм после стандартной химико-механической обработки, полученные в РЭМ в режимах упруго-отраженных электронов (а) и СВЧ-детектирования (б). Микрофотография в режиме упруго-отраженных электронов выявила слабый рельеф поверхности. На поверхности видны две взаимно пересекающиеся, полученные с помощью алмазного скрайбера, царапины (обозначены стрелками), а также надповерхностные дефекты (частицы пыли), оставленные для этих экспериментов в качестве маркеров. На микрофотографии в режиме СВЧ-детектирования в этой области наблюдается более сложная картина. Темное поле здесь соответствует повышенному значению τ . Картина контраста, как и в предыдущем случае, отслеживает царапины на поверхности и затенения надповерхностными дефектами. Дополнительно наблюдается развитая сеть линий, отражающих локальное понижение значения τ вдоль них, по всему полю кадра. Такого типа топография дефектов не была обнаружена с помощью стандартной методики НТ в структуре с барьером Шоттки.

Полученные результаты имеют принципиальное значение для проблемы диагностики качества полупроводниковых материалов. Отметим, что при использовании в регистрирующем тракте фазового детектирования СВЧ-сигнала [4] возможно получение в микромасштабе визуализированного распределения по поверхности пластины

параметра γ в абсолютных единицах. Использованная методика легко может быть распространена на другие полупроводниковые материалы — германий, арсенид галлия и др.

Список литературы

- [1] Leamy H.J. // J. Appl. Phys. 1982. V. 53(6). P. R51-R80.
- [2] Патрин А.А., Сернов С.П., Янченко А.М. // Электронная техника. Сер. 6, Материалы. 1984. В. 1 (186). С. 79-81.
- [3] Тарасик М.И., Якубеня С.Н., Янченко А.М. // Электронная техника. Сер. 6, Материалы. 1985. В. 8 (207). С. 48-50.
- [4] Бураков А.В., Якубеня С.Н., Янченко А.М. // Приборы и техн. эксперимента. 1986. № 5. С. 226.

Поступило в Редакцию
8 февраля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 10 26 мая 1989 г.
06; 09

СТИМУЛИРОВАННОЕ УСИЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ЯДЕРНОГО СПИНОВОГО ЭХА В МАГНЕТИКАХ

Т.М. Шавишили, К.О. Хуцишили,
Н.П. Фокина, Г.В. Лаврентьев

В работе [1] была осуществлена когерентная генерация РЧ сигналов предварительно инвертированными ядерными спинами, взаимодействующими с высокодобротным колебательным контуром, в катушку которого помещен парамагнитный образец. Контур обладал временем радиационного затухания T_d [2], значительно превышающим время звона T_c , но гораздо меньшим времени фазовой памяти спинов T_2 . Генерация начиналась при настройке контура на резонансную частоту ядер. В работе [3] аналогичный эксперимент также обнаруживал стимулированное РЧ излучение. Физическая причина этого явления представляется следующим образом: Известно, что прецессирующая поперечная намагниченность наводит в катушке ЭДС индукции [2]. Если же предварительно перевести систему ядерных моментов в более высокое энергетическое состояние путем создания отрицательной ядерной поляризации, то прецессирующие ядерные моменты наводят в катушке ЭДС индукции, поддерживающую прецессию поперечной намагниченности. В работах [1, 3] с ядерными спинами был связан пассивный контур (ПК), не связанный с источниками питания.